

初心者歓迎

オープンラボHP



ナノファブスクエア 開催案内

新川崎・創造のもり NANOBICオープンラボ
ナノ・マイクロ技術講習・実習会



回	プロセス	実習で利用する装置（場所）	日付
1	フォトマスク作製	レーザ直接描画装置（新川崎）	2024/5/9
2	精密リソグラフィ	両面マスクアライナ（新川崎）	2024/5/23
3	シリコン酸化	酸化炉（海老名）	2024/6/6
4	シリコン異方性エッチング	ドラフト（海老名）	2024/6/13
5	ナノパターン形成	電子線描画装置（海老名）	2024/6/20
6	陽極接合	陽極接合装置（海老名）	2024/6/27
7	シリコンドライエッチング	シリコン深堀りDRIE装置（新川崎）	2024/7/4
8	ガラスエッチング	高密度プラズマドライエッチング装置（新川崎）	2024/11/21
9	マイクロモールディング	レーザ直接描画装置（新川崎）	2024/8/1
10	計算機シミュレーション 1	COMSOL Multiphysics®（新川崎）	2024/8/22
11	計算機シミュレーション 2	COMSOL Multiphysics®（新川崎）	2024/9/5
12	パリレン薄膜形成	パリレン蒸着装置（新川崎）	2024/9/26
13	金属薄膜形成 1	ECRスパッタ（新川崎）	2024/10/3
14	加工表面観察	レーザ顕微鏡、触針式段差計（新川崎）	2024/10/17
15	レジスト塗布	コータデベロッパ装置、スピンコータ（新川崎）	2024/10/31
16	転写プロセス	ナノインプリント（新川崎）	2024/11/14
17	金属薄膜形成 2	4元マグネトロンサイドスパッタ（新川崎）	2024/12/5
18	ウェーハ切断	ダイシングソー（新川崎）	2024/12/19
19	パッケージ	3Dプリンタ（新川崎）	2025/1/9
20	デバイス接合	プラズマ発生装置（新川崎）	2025/1/23(調整中)

場所 : 新川崎・川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり (JR新川崎駅から徒歩10分)
海老名・海老名市下今泉705-1 神奈川県立産業技術総合研究所

実習概要 : マイクロ流路の一連の試作を、シリコン、ガラス、樹脂を使い実施し、表面形態の観察・評価までを行うプログラムにより目的に応じた受講が可能です。

主催 : 4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

定員 : 5名程度(先着) **費用** : 実費(個別チラシに費用を掲載)を負担いただきます。

問合せ : 篠原俊朗 Tel:080-6560-3061 真期彰 Tel:080-6560-3060 E-mail:nano-micro@open-labo.jp

本プログラムは日本工学会のECE(高度技術者教育)プログラム認定のもと、所期の成績を収めた方に修了証と記念品を授与いたしますので、人材育成にご活用下さい。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアムでは、産学連携による技術や産業の創出に寄与するため川崎市、KISTECと連携し、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の開放利用を行なっています。今後、4大学の機器を効果的にご利用いただくため、企業や大学の方を対象としたナノ・マイクロ技術講習・実習会『ナノファブスクエア』の個別チラシを順次掲載し、開催して参りますのでご参加ください。

(オープンラボホームページ <https://open-labo.skr.jp/>)